

【機器利用料金一覧表】

機 器 名	型 式	外 部 利 用 料 金
分析FE-SEM	JSM-7001F(日本電子)	基本料金 10,000円/半日(4時間) EDS分析を行う場合1,000円を追加 EBSD分析を行う場合1,000円を追加
分析SEM	JSM-6610LA(日本電子)	基本料金 5,000円/半日(4時間) EDS分析を行う場合1,000円を追加
クロスセクションポリッシャ	JSM-09010(日本電子)	3,000円/試料
水平型多目的X線回折装置(XRD)	SmartLab(リガク)	4,000円/h
低バックグラウンドゲルマニウム半導体検出器	GEM-30185 (セイコーEG&G)	5,500円/h
超伝導量子干渉装置(磁気特性測定システム)	MPMS(Quantum Design)	12,000円/日
極限環境下物性評価装置(物理特性測定システム)	PPMS(Quantum Design)	20,000円/日
高分解能FT-NMR装置	JNM-EX270(日本電子)	5,500円/h
走査型プローブ顕微鏡	NANO CUTE (セイコーEG&G)	5,000円/件
ラマン分光測定装置	NR-1800S型(日本分光)	3,500円/h
電子線マイクロアナライザ	JXA-8900R(日本電子)	5,000円/h
真空蒸着装置	JEE-400/RST(日本電子)	3,000円/h
小型走査イオン顕微鏡	SM12050(SII・ナノテクノロジー社)	3,000円/h
電界放出型透過分析電子顕微鏡(FE-TEM)	JEM-2100F(日本電子)	7,000円/h
精密イオンポリッシングシステム	Model:691 PIPS(ガタン社)	1,000円/日
湾曲IP X線回折装置	RINT RAPID II(リガク)	基本料金 4,000円 利用料金 400円/h
共焦点レーザー走査型顕微鏡	FV1000-IX81-S-MU(オリンパス)	5,500円/h
紫外-可視分光光度計	UV-1700(島津製作所)	5,000円/日
原子吸光光度計	AA-6300(島津製作所)	
ガスクロマトグラフ	GC-2014(FID/ECD) (島津製作所)	
質量分析システムLC/MS/MS	API2000(AB SCIEX)	5,500円/日

※ 機器利用を希望される方は、経験の有無及び事前講習の必要性等について確認しますので、事前に本学研究基盤設備共用センター事務室にご連絡願います。

研究基盤設備共用センター事務室

〒050-8585 室蘭市水元町27番1号

電話 0143-46-5943

FAX 0143-46-5941